

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

電子ビーム露光装置「F7000 シリーズ」を東大、京大ほかから計 3 台受注 半導体製造装置で培った微細加工技術を幅広い分野に展開

株式会社アドバンテスト（本社：東京都千代田区 社長：松野晴夫）の電子ビーム露光装置「F7000 シリーズ」が、東京大学、京都大学などの大学、半導体関連企業から計 3 台の受注を獲得しました。出荷は 2013 年度内を予定しています。

「F7000 シリーズ」は電子ビームを用いて微細パターンを基板に直接描画する装置です。先端半導体の研究開発に求められる 1 Xnm ノードに対応した微細パターンを、業界トップレベルのスループットで描画することができます。また、セルフ・クリーニング機構やアジャスタ機能により、長時間安定稼働を保ちつつ、さまざまなサイズ、形状、材質の基板に対応します。

この度「F7000 シリーズ」を発注した各顧客では、半導体ウエハや特殊形状試料に加え、MEMS/NEMS（ナノメートルオーダーの MEMS デバイス）、バイオチップなど、新たなデバイスや電子部品の研究開発に活用する予定です。当社は電子ビーム露光による先端の微細加工技術を幅広い分野に展開し、先端デバイス研究・開発の発展に貢献していきます。

当製品についてのお問い合わせ先

ナノテクノロジー事業部

メールアドレス : info_nano@ml.advantest.com

電子ビーム露光装置「F7000 シリーズ」